

Środa 02.04.2025

godziny	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7
8:30-9:30	Rejestracja i kawa						
9:30-10:30	Seminarium z technik nanoszenia powłok w auli						
10:30-12:00	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone
12:00-12:30	Przerwa kawowa						
12:30-14:00	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz
14:00-14:45	Przerwa lunchowa						
14:45-16:15	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski

Czwartek 03.04.2025

godziny	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7
9:00-10:30	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny
10:30-12:00	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf
12:00-12:30	Przerwa kawowa						
12:30-14:00	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy
14:00-14:45	Przerwa lunchowa						
14:45-16:15	Mikroskop AFM do instalacji w SEM, SEM indenter + prezentacja uXRF i Techniki Łączone	Tribometr, Nanotwardościomierz	LIBS + Spektrometr ramanowski	Mikroskop cyfrowy i mikroskop optyczny	mikrotomograf	Profilometr optyczny, reflektometr, profilometr stykowy	Maszyna wytrzymałościowa i maszyna zmęczeniowa